Сведения о календарной загрузке оборудования ЦКП ИФМ РАН на 2017 год

Оборудование	Январь			Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				ноябрь				декабрь			
	09.01-13.01	16.01-20.01	23.01-27.01	31.01-03.02	06.02-10.02	13.02-17.02	20.02-24.02	27.02-03.31	06.03-10.03	13.03-17.03	20.03-24.03	27.03-31.03	03.04-07.04	10.04-14.04	17.04-21.04	24.04-28.04	02.05-05.05	10.05-12.05	15.05-19.05	22.05-26.05	29.05-02.06	05.06-09.06	13.06-16.06	19.06-23.06	26.06-30.06					01.08-04.08	07.08-11.08	14.08-18.08	21.08-25.08	28.08-01.09	04.09-08.09	11.09-15.09	18.09-22.09	15.09-29.09	02.10-06.10	09.10-13.10	16.10-20.10	23.10-27.10	30.10-02.11	07.11-10.11	13.11-17.11	20.11-24.11	27.11-01.12	04.12-08.12	11.12-15.12	18.12-22.12	25.12-29.12
Дифрактометр рентгеновский XPert PRO MRD (Philips)																																																
Дифрактометр рентгеновский PANalitical XPert PRO MRD (Philips)																																																
Лазерно-плазменный источник рентгеновского излучения																																																
Сканирующий зондовый микроскоп Solver PRO-HV (НТ-МДТ)																																																
ИК-Фурье спектрометр BOMEM DA3.36																																																
ИК-Фурье спектрометр Vertex 80V (Bruker)																																																
Фурье-спектрометр Инфралюм ФТ-801																																																
Сканирующий электронный микроскоп Supra 50VP (Carl																																																
Измерительная система Talysurf CCI 2000 (Taylor)																																																
Вторично-ионный масс-спектрометр TOF-SIMS 5-100 (IONTOF)																																																
Установка реактивного ионного травления с источником индуктивно связанной плазмы																																																
Сверхпроводящая магнитная система																																																
Анализатор спектра																																																
Двухлучевая система с высоким разрешением для исследования и подготовки образцов Neon-40 (Carl Zeiss)																																																
Цифровой осциллограф																																																
Дифрактометр ренгеновский D8 Discover																																																
Лазерный генератор микро-изображений mPG101																																																
Станция ожижения гелия Cryomech LHeP18 с системой сбора газообразного гелия																																																
Генератор сигналов Agilent Technologies E8257D																																																
Атомно-силовой микроскоп Ntegra Prima																																																
Сканирующий мульти-микроскоп СММ-2000																																																
Вакуумная установка резистивного и электронно-лучевого испарения с холловским ионным источником Amod 206																																																
Автоэмиссионный просвечивающий электронный микроскоп LIBRA® 200MC																																																
Профилометр model 130 (Протон-МИЭТ)																																																
Сканирующий туннельный микроскоп LT UHV SPM - Multiprobe S/XA (Omicron Nanotechnolgy)																																																

- На это время можно подать заявку на выполнение работ на установке

-Установка частично загружена. Заявки принимаются. конкретное всемя работы потребует дополнительного согласования

-Установка загружена либо находится на ремонте/профилактике. Заявки не принимаются.